

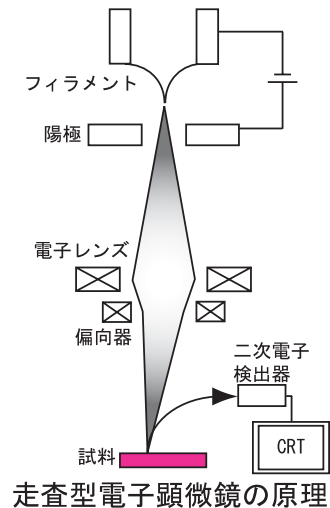
ナノ構造解析実験室 走査型電子顕微鏡

～電子線を使ってナノスケールで観察する～

装置の概要

走査型電子顕微鏡 (SEM) はナノメートルスケールで観察試料表面の凹凸や、組成の違いを見るための顕微鏡です。

電子源で発生させた電子を電子レンズで集束させることにより形成される微小径の電子線をプローブとして用います。偏向器を用いてこの電子線を観察試料表面上でX方向、Y方向に走査させ、走査と同期して表面から放出される二次電子、反射電子を検出しCRTに表示することによりSEM像を得ることができます。



仕様

JSM-6060LV (JEOL)

分解能: 3.5nm (30kV)

倍率 : 8~300,000倍

像の種類: 二次電子像、反射電子像

加速電圧: 0.5~30kV

電子銃: タングステン

試料移動範囲: X: 20mm, Y: 10mm, Z: 43mm

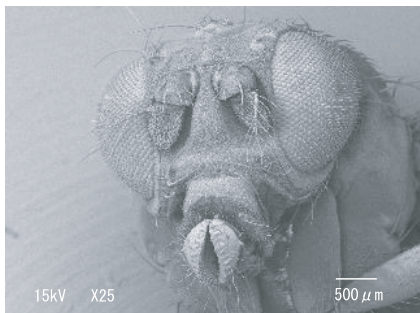
傾斜: -10~+90°, 回転: 360°

最大試料サイズ: 32mmφ

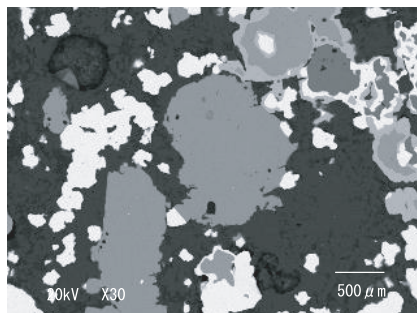


走査型電子顕微鏡外観

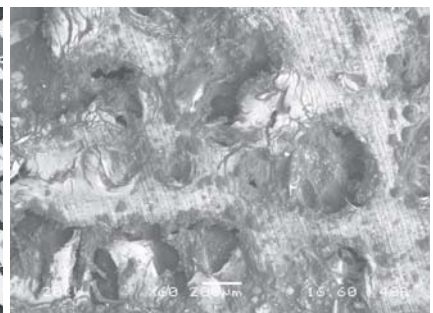
参考データ



昆虫



鉱物



ヒト距骨切断面の反射電子像